



检测报告

报告编号 A2190339094161CQ001

第 1 页 共 40 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 工业废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18842CAEEB

报告说明

报告编号 A2190339094161CQ001

第 2 页 共 40 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别声明本报告只适用于本次采集/收到的受检样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对受检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐金艳

签

发：

乔杰

签发人姓名：

乔杰

审

核：

戴利利

签发日期：

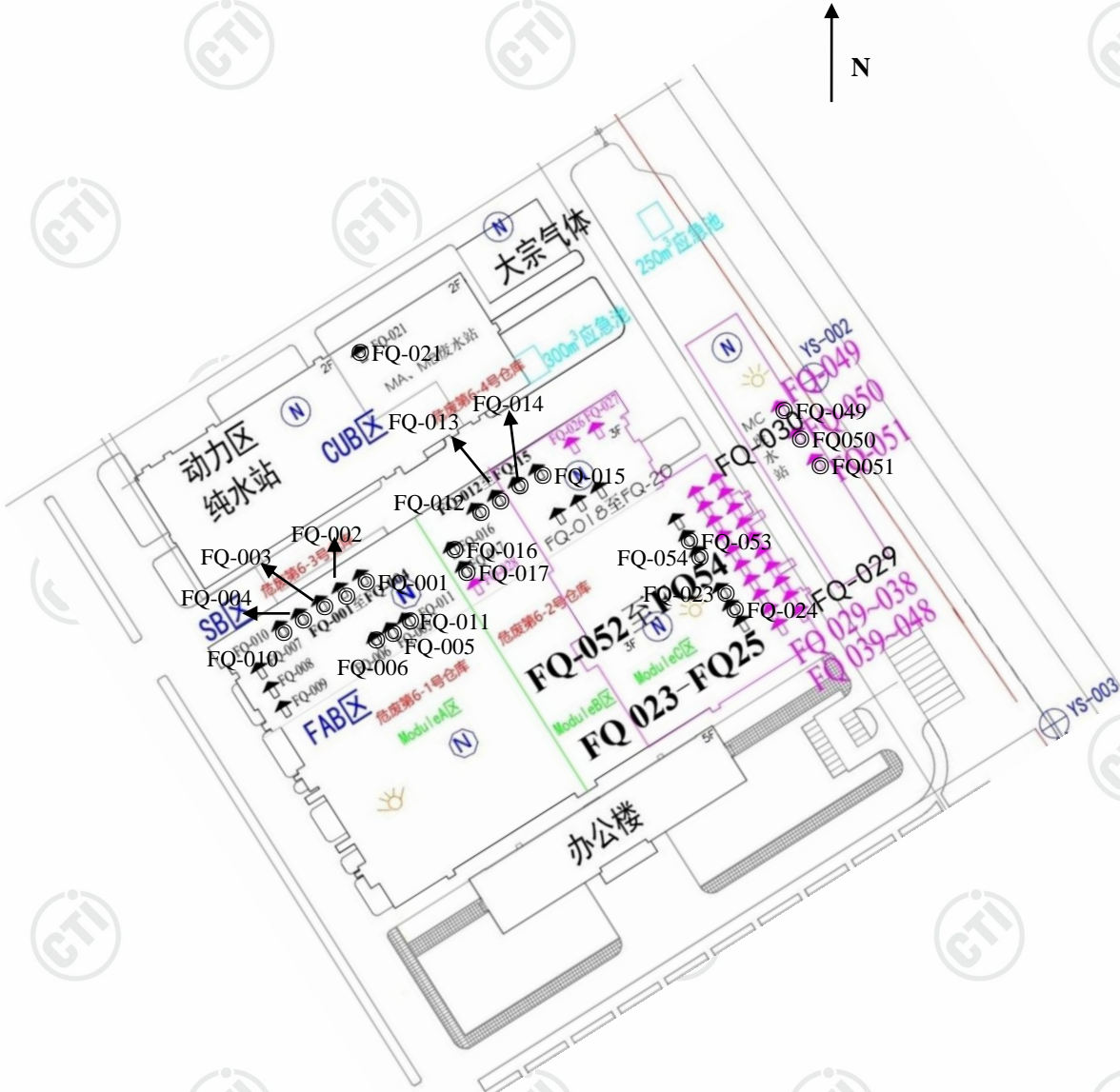
2023/06/29

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 3 页 共 40 页

附：检测布点图



说明：◎工业废气有组织采样点

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 4 页 共 40 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		鲍磊、石双瑜		
采样日期		2023-05-18		检测日期		2023-05-18~2023-05-22		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-012	氟化物	SUP40470004	0.28	9.55×10 ⁻³	30792	1.5	---	33.5
		SUP40470005	0.32					
		SUP40470006	0.34					
		平均值	0.31					
	氮氧化物	SUP40470001	4	/	30792	50 ^a	---	
		SUP40470002	ND					
		SUP40470003	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP40470010	0.50	3.63×10 ⁻²	30232	10	---	
		SUP40470011	1.22					
		SUP40470012	1.88					
		平均值	1.20					
	氯气	SUP40470013	0.4	1.53×10 ⁻²	30650	5.0	---	
		SUP40470014	0.5					
		SUP40470015	0.5					
		平均值	0.5					
	硫酸雾	SUP40470007	0.39	1.24×10 ⁻²	30232	5.0	---	
		SUP40470008	0.48					
		SUP40470009	0.35					
		平均值	0.41					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 5 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470001/ 004/014	24	7.5	100.3	1.3273	31338
SUP40470002/ 005	24	7.3	100.3	1.3273	30528
SUP40470003/ 006/015	24	7.3	100.3	1.3273	30511
SUP40470007/ 010/013	24	7.2	100.3	1.3273	30102
SUP40470008/ 011	24	7.1	100.3	1.3273	29680
SUP40470009/ 012	24	7.4	100.3	1.3273	30915
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-012 管道直径 1.30m，采样孔位于弯道下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 6 页 共 40 页

表 2:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		鲍磊、石双瑜		
采样日期		2023-05-18		检测日期		2023-05-18~2023-05-22		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-013	氟化物	SUP40470019	0.30	1.09×10 ⁻²	33932	1.5	---	33.5
		SUP40470020	0.34					
		SUP40470021	0.33					
		平均值	0.32					
	氮氧化物	SUP40470016	ND	/	33932	50 ^a	---	
		SUP40470017	ND					
		SUP40470018	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP40470025	0.76	3.12×10 ⁻²	33508	10	---	
		SUP40470026	0.98					
		SUP40470027	1.04					
		平均值	0.93					
	氯气	SUP40470028	0.2	6.84×10 ⁻³	34211	5.0	---	
		SUP40470029	ND					
		SUP40470030	0.4					
		平均值	0.2					
	硫酸雾	SUP40470022	0.44	1.34×10 ⁻²	33508	5.0	---	
		SUP40470023	0.35					
		SUP40470024	0.42					
		平均值	0.40					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 7 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470016/ 019/029	23	8.1	100.4	1.3273	33946
SUP40470017/ 020	24	7.9	100.4	1.3273	33082
SUP40470018/ 021/030	23	8.3	100.4	1.3273	34767
SUP40470022/ 025/028	24	8.1	100.3	1.3273	33920
SUP40470023/ 026	23	7.9	100.4	1.3273	33070
SUP40470024/ 027	23	8.0	100.4	1.3273	33534
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-013 管道直径 1.30m，采样孔位于变径处下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 8 页 共 40 页

表 3:

样品信息:												
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		崔凯杰、李渊						
采样日期		2023-05-18		检测日期		2023-05-18~2023-05-22						
采样方式		连续		样品状态		完好						
检测结果:												
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m				
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h					
FQ-014	氟化物	SUP40470034	0.40	1.26×10 ⁻²	32222	1.5	---	33.5				
		SUP40470035	0.39									
		SUP40470036	0.37									
		平均值	0.39									
	氮氧化物	SUP40470031	ND	/	32331	50 ^a	---					
		SUP40470032	ND									
		SUP40470033	ND									
		平均值	ND									
	氯化氢	SUP40470040	0.56	2.16×10 ⁻²	32222	10	---					
		SUP40470041	0.90									
		SUP40470042	0.55									
		平均值	0.67									
	氯气	SUP40470043	0.3	1.28×10 ⁻²	32121	5.0	---					
		SUP40470044	ND									
		SUP40470045	0.7									
		平均值	0.4									
	硫酸雾	SUP40470037	0.30	/	32297	5.0	---					
		SUP40470038	ND									
		SUP40470039	ND									
		平均值	ND									

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 9 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470031/ 032/037	23	7.7	100.4	1.3273	32353
SUP40470033/ 039/045	24	7.7	100.4	1.3273	32286
SUP40470034/ 040/043	24	7.6	100.4	1.3273	31823
SUP40470035/ 041	24	7.7	100.4	1.3273	32190
SUP40470036/ 042	24	7.8	100.4	1.3273	32653
SUP40470038/ 044	24	7.7	100.4	1.3273	32253
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-014 管道直径 1.30m，采样孔位于变径处下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 10 页 共 40 页

表 4:

样品信息:								
样品类型	工业废气（有组织）			采样人员	崔凯杰、李渊			
采样日期	2023-05-18			检测日期	2023-05-18~2023-05-22			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-015	氟化物	SUP40470049	0.42	1.28×10 ⁻²	33631	1.5	---	33.5
		SUP40470050	0.38					
		SUP40470051	0.34					
		平均值	0.38					
	氮氧化物	SUP40470046	ND	/	33398	50 ^a	---	
		SUP40470047	ND					
		SUP40470048	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP40470055	0.65	2.12×10 ⁻²	33631	10	---	
		SUP40470056	0.78					
		SUP40470057	0.45					
		平均值	0.63					
	氯气	SUP40470058	0.6	1.67×10 ⁻²	33421	5.0	---	
		SUP40470059	0.4					
		SUP40470060	0.4					
		平均值	0.5					
	硫酸雾	SUP40470052	0.27	/	33398	5.0	---	
		SUP40470053	0.20					
		SUP40470054	ND					
		平均值	ND					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 11 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470046/ 052	26	8.1	100.5	1.3273	33758
SUP40470047/ 053/059	25	8.1	100.5	1.3273	33779
SUP40470048/ 054/060	24	7.8	100.5	1.3273	32658
SUP40470049/ 055/058	26	8.1	100.5	1.3273	33827
SUP40470050/ 056	28	8.1	100.5	1.3273	33455
SUP40470051/ 057	27	8.1	100.5	1.3273	33610
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-015 管道直径 1.30m，采样孔位于变径处下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 12 页 共 40 页

表 5:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		蔡洋洋、裴鹏程				
采样日期		2023-05-19		检测日期		2023-05-19~2023-05-26				
采样方式		连续		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-001	氟化物	SUP40470064	1.03	5.50×10 ⁻²	51846	1.5	---	33.5		
		SUP40470065	1.12							
		SUP40470066	1.02							
		平均值	1.06							
	氮氧化物	SUP40470061	ND	/	50357	50 ^a	---			
		SUP40470062	ND							
		SUP40470063	ND							
		平均值	ND							
	氯化氢	SUP40470070	7.73	0.280	52326	10	---			
		SUP40470071	2.01							
		SUP40470072	6.35							
		平均值	5.36							
	氯气	SUP40470073	1.4	7.78×10 ⁻²	51846	5.0	---			
		SUP40470074	1.6							
		SUP40470075	1.4							
		平均值	1.5							
	硫酸雾	SUP40470067	0.98	3.98×10 ⁻²	50357	5.0	---			
		SUP40470068	1.19							
		SUP40470069	0.21							
		平均值	0.79							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 13 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470061/ 067/071/072	16	12.0	101.2	1.3273	51819
SUP40470062/ 068	15	11.3	101.1	1.3273	49253
SUP40470063/ 069	15	11.5	101.1	1.3273	49998
SUP40470064/ 070/073	17	12.4	101.2	1.3273	53339
SUP40470065/ 074	15	11.7	101.2	1.3273	50852
SUP40470066/ 075	15	11.8	101.1	1.3273	51347
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-001 管道直径 1.30m，采样孔位于变径处下游 360cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 14 页 共 40 页

表 6:

样品信息:								
样品类型	工业废气（有组织）			采样人员	蔡洋洋、裴鹏程			
采样日期	2023-05-19			检测日期	2023-05-19~2023-05-26			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-002	氟化物	SUP40470079	1.22	4.48×10 ⁻²	32469	1.5	---	33.5
		SUP40470080	1.54					
		SUP40470081	1.39					
		平均值	1.38					
	氮氧化物	SUP40470076	ND	/	32018	50 ^a	---	
		SUP40470077	ND					
		SUP40470078	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP40470085	2.14	8.82×10 ⁻²	32429	10	---	
		SUP40470086	2.83					
		SUP40470087	3.19					
		平均值	2.72					
	氯气	SUP40470088	1.3	4.22×10 ⁻²	32469	5.0	---	
		SUP40470089	1.4					
		SUP40470090	1.3					
		平均值	1.3					
	硫酸雾	SUP40470082	0.29	1.47×10 ⁻²	32018	5.0	---	
		SUP40470083	0.58					
		SUP40470084	0.51					
		平均值	0.46					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 15 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470076/ 082/086/087	16	7.5	101.0	1.3273	32414
SUP40470077/ 083	17	7.2	100.9	1.3273	30951
SUP40470078/ 084	16	7.6	100.9	1.3273	32688
SUP40470079/ 085/088	15	7.5	101.0	1.3273	32460
SUP40470080/ 089	16	7.3	100.9	1.3273	31671
SUP40470081/ 090	16	7.7	100.9	1.3273	33275
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-002 管道直径 1.30m，采样孔位于排气口上游 430cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 16 页 共 40 页

表 7:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		蔡洋洋、裴鹏程		
采样日期		2023-05-22		检测日期		2023-05-22~2023-05-25		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-003	氟化物	SUP40470094	0.70	3.86×10 ⁻²	41488	1.5	---	33.5
		SUP40470095	1.20					
		SUP40470096	0.90					
		平均值	0.93					
	氮氧化物	SUP40470091	7	0.326	40785	50 ^a	---	
		SUP40470092	8					
		SUP40470093	8					
		平均值	8					
	氯化氢	SUP40470100	1.28	3.67×10 ⁻²	41242	10	---	
		SUP40470101	0.52					
		SUP40470102	0.88					
		平均值	0.89					
	氯气	SUP40470103	1.7	8.30×10 ⁻²	41488	5.0	---	
		SUP40470104	1.9					
		SUP40470105	2.4					
		平均值	2.0					
	硫酸雾	SUP40470097	ND	/	40785	5.0	---	
		SUP40470098	ND					
		SUP40470099	ND					
		平均值	ND					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 17 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470091/ 097/102	17	9.6	101.2	1.3273	41394
SUP40470092/ 098	17	9.0	101.2	1.3273	38804
SUP40470093/ 099	18	9.8	101.2	1.3273	42157
SUP40470094/ 100/101/103	17	9.5	101.2	1.3273	41166
SUP40470095/ 104	17	9.6	101.2	1.3273	41393
SUP40470096/ 105	17	9.7	101.2	1.3273	41906
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-003 管道直径 1.30m，采样孔位于排气口上游 430cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 18 页 共 40 页

表 8:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		蔡洋洋、裴鹏程				
采样日期		2023-05-22		检测日期		2023-05-22~2023-05-25				
采样方式		连续		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h			
FQ-004	氟化物	SUP40470109	1.50	4.27×10 ⁻²	35027	1.5	---	33.5		
		SUP40470110	1.00							
		SUP40470111	1.16							
		平均值	1.22							
	氮氧化物	SUP40470106	8	0.232	33139	50 ^a	---			
		SUP40470107	8							
		SUP40470108	5							
		平均值	7							
	氯化氢	SUP40470115	0.59	3.34×10 ⁻²	34132	10	---			
		SUP40470116	1.56							
		SUP40470117	0.79							
		平均值	0.98							
	氯气	SUP40470118	2.3	7.71×10 ⁻²	35027	5.0	---			
		SUP40470119	2.4							
		SUP40470120	2.0							
		平均值	2.2							
	硫酸雾	SUP40470112	ND	/	33139	5.0	---			
		SUP40470113	ND							
		SUP40470114	0.23							
		平均值	ND							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 19 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470106/ 112/116/117	17	7.8	101.2	1.3273	33604
SUP40470107/ 113	18	7.2	101.2	1.3273	30977
SUP40470108/ 114	17	8.1	101.2	1.3273	34837
SUP40470109/ 115/118	17	8.1	101.2	1.3273	35189
SUP40470110/ 119	18	8.0	101.2	1.3273	34433
SUP40470111/ 120	17	8.2	101.2	1.3273	35458
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.FQ-004 管道直径 1.30m，采样孔位于排气口上游 430cm，采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。 6.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 7.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 20 页 共 40 页

表 9:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		崔凯杰、李渊				
采样日期		2023-05-19		检测日期		2023-05-19~2023-05-24				
采样方式		连续/瞬时		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-053	二氧化硫	SUP40470121	ND	/	22307	200	1.4	33.5		
		SUP40470122	ND							
		SUP40470123	ND							
		平均值	ND							
	氮氧化物	SUP40470121	6	0.112	22307	100	0.47			
		SUP40470122	5							
		SUP40470123	5							
		平均值	5							
	颗粒物	SUP40470130	1.1	4.30×10 ⁻²	22620	20	1			
		SUP40470131	1.5							
		SUP40470132	3.1							
		平均值	1.9							
	异丙醇	SUP40470127	0.074	1.82×10 ⁻³	22707	40	---			
		SUP40470128	0.107							
		SUP40470129	0.058							
		平均值	0.080							
	非甲烷总烃	SUP40470124	1.08	2.77×10 ⁻²	22707	50	---			
		SUP40470125	1.24							
		SUP40470126	1.35							
		平均值	1.22							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 21 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470121/ 122/126/129/ 131	44	9.2	101.3	0.7854	22081
SUP40470123/ 132	45	9.5	101.3	0.7854	22760
SUP40470124/ 125/127/128/ 130	44	9.6	101.3	0.7854	23020
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和客户提供限值中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 22 页 共 40 页

表 10:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		张显、李小峰		
采样日期		2023-05-22		检测日期		2023-05-23~2023-05-25		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-049	氯化氢	SUP40470133	1.14	3.32×10 ⁻³	2888	10	---	33.5
		SUP40470134	0.99					
		SUP40470135	1.31					
		平均值	1.15					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²		标干流量 m³/h	
SUP40470133/ 134/135		22	3.2	101.4	0.2827		2888	
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3						
备注：1.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 2.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 23 页 共 40 页

表 11:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		贺玖山、潘江		
采样日期		2023-05-22		检测日期		2023-05-23~2023-05-25		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-021	氯化氢	SUP40470139	1.30	7.47×10 ⁻³	5221	10	---	25
		SUP40470140	1.47					
		SUP40470141	1.53					
		平均值	1.43					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h		
SUP40470139		21	3.2	100.9	0.5027	5211		
SUP40470140		20	3.2	100.9	0.5027	5227		
SUP40470141		20	3.2	100.9	0.5027	5224		
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3						
备注：1.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
2.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 24 页 共 40 页

表 12:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		张显、李小峰		
采样日期		2023-05-22		检测日期		2023-05-23		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ050	氨	SUP40470166	0.64	1.48×10 ⁻³	3598	10	---	33.5
		SUP40470167	0.34					
		SUP40470168	0.26					
		平均值	0.41					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP40470166		22	3.6	101.4		0.2827		3244
SUP40470167		22	4.2	101.3		0.2827		3861
SUP40470168		20	4.0	101.4		0.2827		3688
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注：1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 25 页 共 40 页

表 13:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		张显、李小峰		
采样日期		2023-05-22		检测日期		2023-05-22~2023-05-23		
采样方式		连续/瞬时		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ051	氨	SUP40470169	0.42	5.25×10 ⁻⁴	1874	10	---	33.5
		SUP40470170	ND					
		SUP40470171	0.30					
		平均值	0.28					
	硫化氢	SUP40470175	ND	/	1845	---	1.80	
		SUP40470176	ND	/	1888			
		SUP40470177	ND	/	1889			
		最大值	ND	/	1889			
	臭气浓度	SUP40470172	151（无量纲）			15000（无量纲）		
		SUP40470173	173（无量纲）					
		SUP40470174	131（无量纲）					
		最大值	173（无量纲）					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h		
SUP40470169/ 175		22	3.6	101.3	0.1590	1845		
SUP40470170/ 176		21	3.7	101.3	0.1590	1888		
SUP40470171/ 177		21	3.7	101.4	0.1590	1889		
参照标准		硫化氢、臭气浓度：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物 排放标准值 氨：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3						
备注：1.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和 GB 14554-1993 表 2 标准中未对该项目作限制。 4.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 26 页 共 40 页

表 14:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		鲍磊、石双瑜				
采样日期		2023-05-19		检测日期		2023-05-19~2023-05-24				
采样方式		连续/瞬时		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-054	二氧化硫	SUP40470313	ND	/	22546	200	1.4	33.5		
		SUP40470314	ND							
		SUP40470315	ND							
		平均值	ND							
	氮氧化物	SUP40470313	ND	/	22546	100	0.47			
		SUP40470314	ND							
		SUP40470315	ND							
		平均值	ND							
	颗粒物	SUP40470322	1.4	3.63×10 ⁻²	22712	20	1			
		SUP40470323	1.7							
		SUP40470324	1.6							
		平均值	1.6							
	异丙醇	SUP40470319	ND	/	22641	40	---			
		SUP40470320	ND							
		SUP40470321	ND							
		平均值	ND							
	非甲烷总烃	SUP40470316	1.27	3.03×10 ⁻²	22641	50	---			
		SUP40470317	1.34							
		SUP40470318	1.42							
		平均值	1.34							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 27 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470313/ 314/318/321/ 323	43	9.3	100.8	0.7854	22309
SUP40470315/ 324	43	9.6	100.7	0.7854	23020
SUP40470316/ 317/319/320/ 322	43	9.5	100.8	0.7854	22807
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 28 页 共 40 页

表 15:

样品信息:										
样品类型	工业废气（有组织）			采样人员	崔凯杰、李渊					
采样日期	2023-05-19			检测日期	2023-05-19~2023-05-24					
采样方式	连续/瞬时			样品状态	完好					
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-023	二氧化硫	SUP40470325	ND	/	21509	200	1.4	33.5		
		SUP40470326	ND							
		SUP40470327	ND							
		平均值	ND							
	氮氧化物	SUP40470325	8	0.129	21509	100	0.47			
		SUP40470326	9							
		SUP40470327	ND							
		平均值	6							
	颗粒物	SUP40470334	2.7	3.67×10 ⁻²	21575	20	1			
		SUP40470335	1.1							
		SUP40470336	1.4							
		平均值	1.7							
	异丙醇	SUP40470331	0.058	4.32×10 ⁻⁴	21587	40	---			
		SUP40470332	ND							
		SUP40470333	ND							
		平均值	0.020							
	非甲烷总烃	SUP40470328	1.45	3.00×10 ⁻²	21587	50	---			
		SUP40470329	1.38							
		SUP40470330	1.33							
		平均值	1.39							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 29 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470325/ 326/330/333/ 335	53	9.2	101.1	0.7854	21456
SUP40470327/ 336	54	9.3	101.1	0.7854	21616
SUP40470328/ 329/331/332/ 334	50	9.2	101.2	0.7854	21652
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 30 页 共 40 页

表 16:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		鲍磊、石双瑜				
采样日期		2023-05-19		检测日期		2023-05-19~2023-05-24				
采样方式		连续/瞬时		样品状态		完好				
检测结果:										
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m		
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h			
FQ-024	二氧化硫	SUP40470337	ND	/	14904	200	1.4	33.5		
		SUP40470338	ND							
		SUP40470339	ND							
		平均值	ND							
	氮氧化物	SUP40470337	ND	/	14904	100	0.47			
		SUP40470338	3							
		SUP40470339	ND							
		平均值	ND							
	颗粒物	SUP40470346	1.7	3.66×10 ⁻²	15262	20	1			
		SUP40470347	3.1							
		SUP40470348	2.5							
		平均值	2.4							
	异丙醇	SUP40470343	ND	2.09×10 ⁻⁴	14904	40	---			
		SUP40470344	ND							
		SUP40470345	0.041							
		平均值	0.014							
	非甲烷总烃	SUP40470340	1.38	1.85×10 ⁻²	14904	50	---			
		SUP40470341	1.20							
		SUP40470342	1.15							
		平均值	1.24							

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 31 页 共 40 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	标干流量 m³/h
SUP40470337/ 338/340/341/ 343/344/346	58	6.4	100.7	0.7854	14603
SUP40470339/ 342/345/347	58	6.8	100.6	0.7854	15505
SUP40470348	59	6.9	100.6	0.7854	15678
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃：《半导体行业污染物排放标准》（DB 32/3747-2020）表 3				
备注：1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 32 页 共 40 页

表 17:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		蔡洋洋、裴鹏程		
采样日期		2023-05-18		检测日期		2023-05-19		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓 度 mg/m³	排放 速率 kg/h	
FQ-005	氨	SUP40470352	ND	4.97×10 ⁻³	16568	10	---	33.5
		SUP40470353	0.27					
		SUP40470354	0.50					
		平均值	0.30					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP40470352		15	6.4	100.5		0.7854		16530
SUP40470353		14	6.3	100.6		0.7854		16358
SUP40470354		14	6.5	100.5		0.7854		16815
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注：1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-006 管道直径 1.00m，采样孔位于变径处下游 400cm，采样孔直径 10cm。								
4.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表 22。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 33 页 共 40 页

表 18:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		蔡洋洋、裴鹏程		
采样日期		2023-05-18		检测日期		2023-05-19		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-006	氨	SUP40470355	0.44	9.07×10 ⁻³	16199	10	---	33.5
		SUP40470356	0.53					
		SUP40470357	0.70					
		平均值	0.56					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP40470355		14	6.1	100.5		0.7854		15652
SUP40470356		14	6.4	100.5		0.7854		16581
SUP40470357		14	6.3	100.5		0.7854		16365
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注: 1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-006 管道直径 1.00m，采样孔位于变径处下游 400cm，采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001

第 34 页 共 40 页

表 19:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		蔡洋洋、裴鹏程		
采样日期		2023-05-18		检测日期		2023-05-19		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-016	氨	SUP40470358	0.50	7.99×10 ⁻³	18160	10	---	33.5
		SUP40470359	0.31					
		SUP40470360	0.51					
		平均值	0.44					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP40470358		15	7.3	100.6		0.7854		18825
SUP40470359		15	7.1	100.5		0.7854		18246
SUP40470360		15	6.8	100.5		0.7854		17410
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注: 1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-016 管道直径 1.00m，采样孔位于变径处下游 400cm，采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 35 页 共 40 页

表 20:

样品信息:								
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		蔡洋洋、裴鹏程		
采样日期		2023-05-18		检测日期		2023-05-19		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标干流量 m³/h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
FQ-017	氨	SUP40470361	0.58	7.37×10 ⁻³	17548	10	---	33.5
		SUP40470362	0.41					
		SUP40470363	0.27					
		平均值	0.42					
烟气参数:								
烟气参数		烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa		截面 m²		标干流量 m³/h
SUP40470361		15	6.9	100.6		0.7854		17830
SUP40470362		14	6.7	100.6		0.7854		17196
SUP40470363		15	6.8	100.6		0.7854		17617
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》（DB/3747-2020）表 3 大气污染物排放限值						
备注: 1.排气筒高度由受检单位提供。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-017 管道直径 1.00m，采样孔位于变径处下游 400cm，采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 36 页 共 40 页

表 21:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氟化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20202843	2023-10-19
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		离子计	PXSJ-216F	TTE20213340	2023-09-27
	颗粒物	电子天平	BT 125D	TTE20100253	2023-07-28
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
	二氧化硫	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
	氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20202843	2023-10-19
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 37 页 共 40 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氯化氢	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20120654	2024-04-14
		离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2023-07-21
		双路烟气采样器	ZR-3710 型	TTE20171710	2024-03-29
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2024-01-02
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20202843	2023-10-19
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212465	2023-08-30
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20221874	2023-06-30
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20224367	2023-10-16
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224472	2023-11-01
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224473	2023-11-01
	硫酸雾	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2023-07-21
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20202843	2023-10-19
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 38 页 共 40 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氯气	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20202843	2023-10-19
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20212603	2023-11-01
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20221874	2023-06-30
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224472	2023-11-01
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224473	2023-11-01
	非甲烷总烃	气相色谱仪 (GC)	GC-2014	TTE20172480	2024-03-15
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
	硫化氢	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2024-01-02
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212465	2023-08-30
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 39 页 共 40 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氨	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2024-01-02
		大流量低浓度烟尘气测试仪	3012H-D 型 (18 款)	TTE20202843	2023-10-19
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212465	2023-08-30
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224473	2023-11-01
	异丙醇	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2023-10-10
		气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	7890B-5977B	TTE20181868	2024-08-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200002	2024-01-02
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224472	2023-11-01
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224473	2023-11-01

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094161CQ001 第 40 页 共 40 页

表 22:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
工业废气 (有组织)	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06mg/m ³
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m ³
	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	0.2mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(国家环保总局 2003 年 第四版增补版) 第五篇 第四章 十 (三)	0.01mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/
	异丙醇	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.002mg/m ³

报告结束